

マイクロナノ2007 MEMSフォーラム（標準化セッション）

（1）開催主旨

MEMS分野における標準化についてわが国は、MEMS専門用語、薄膜材料引張り試験法に関する国際規格化を果たすなど、マイクロマシンセンターは積極的に国際標準化活動を推進しています。

マイクロナノ2007MEMSフォーラム標準化セッションは、国際規格として発行されたMEMS専門用語及び薄膜材料引張り試験法の紹介とその活用を通して、我が国がMEMS分野の国際標準化への取り組みを今後より戦略的に進展させるべく、国際規格活用の啓発活動として開催します。

（2）プログラム

マイクロナノ2007 MEMSフォーラム - 国際標準化セッション - - MEMS 国際標準の活用 -		
日時：2007年7月27日(金) 10:00～12:00 会場：東京ビッグサイト 西3ホール内 特設会場 主催：(財)マイクロマシンセンター 標準化事業委員会 / MEMS 協議会 参加費：無料		
司会：(財)マイクロマシンセンター 見持 律往		
10:00～10:05	挨拶	(財)マイクロマシンセンター標準化事業委員会 委員長 大山 尚武
10:05～10:20	経済産業省の国際標準化政策	経済産業省産業技術環境局電子標準化推進室長 和泉 章
10:20～10:45	MEMSの国際標準化動向と標準化ロードマップ	国際標準化学工研究所代表 帝京大学理工学部情報科学科 教授 大和田邦樹
10:45～11:10	MEMS用語集規格の概要	首都大学東京 システムデザイン学部 教授 諸貫 信行
11:10～11:35	引張試験法と標準試験片規格の概要	熊本大学大学院 自然科学研究科マテリアル工学専攻 教授 高島 和希
11:35～11:55	試験装置の国際規格への対応について ～試験機メーカーの観点から～	㈲島津製作所 分析計測事業部 応用技術部 試験計測グループ 長谷川 忠
11:55～12:00	閉会挨拶	(財)マイクロマシンセンター 専務理事 青柳 桂一

会場案内図

